

第50回未来化学創造センターセミナー
共催：(財)九州先端科学技術研究所 (ISIT)



日時：2010年1月12(火) 15時00分～16時00分
会場：九州大学伊都キャンパス W4号館423号室

< 参加無料 >

講演者：

Key Laboratory of Advanced Display and System Applications,
Ministry of Education, Shanghai University

Ms. Bo LI

題目： Wet Process in Producing of OLED

講演内容：

- I. Performance improvement of POLED with CBP layer
- II. Chromatic-stable and controllable WOLED using CCM method
- III. Comparison of WOLED using MEH-PPV as CCM and CC-HIL respectively

略歴：

2004 - 2007 Nankai University
2007 - Present Shanghai University

連絡先および問い合わせ先：

九州大学未来化学創造センター 安達千波矢
E-mail: adachi@cstf.kyushu-u.ac.jp、TEL: 092-802-3306

(財)九州先端科学技術研究所 (ISIT) 新産業支援室 八尋 正幸
E-mail: yahiro@isit.or.jp、TEL: 092-805-3810